Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Laboratorium problemowe II

Magnetyczna lewitacja

Autorzy:
Piotr Pałucki
Filip Kubicz

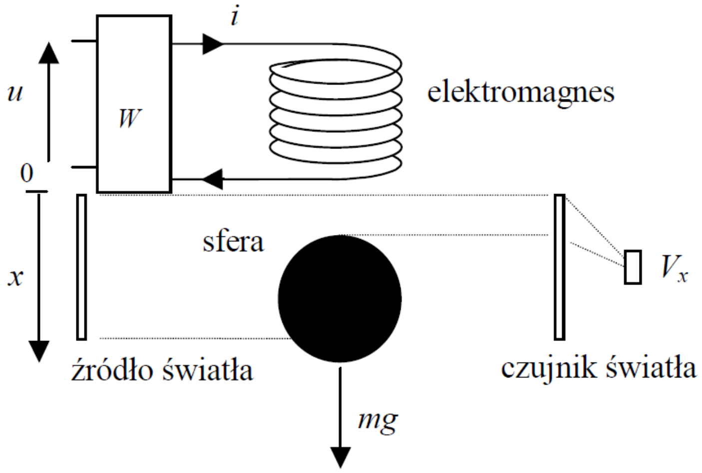
Plan działania na 9 zajęć laboratoryjnych (10 X 2016 - 12 XII 2016):

1. Identyfikacja - scenariusze badań i sygnałów sterujących
2. Optymalizacja parametryczna modelu
3. Model zlinearyzowany + LQR (model + eksperyment -¿ dyskusja)
4. Dyskretny regulator (porównanie z ciągłym)
5. Dyskretny regulator - eksperymenty
6. Obserwator
7. Obserwator - eksperymenty i jakość regulacji
8. Eksperymenty
9. Prezentacja końcowa wyników pracy

1 Model matematyczny stanowiska MagLev

Lewitacja magnetyczna to zjawisko występujące, kiedy ferromagnetyczny obiekt znajdzie się w polu magnetycznym skierowanym pionowo w górę, na tyle silnym, że wytworzona siła zrównoważy działającą na przedmiot grawitację. Zjawisko to stosuje się obecnie w łożyskach magnetycznych w pociągach, rozwijanych głównie w Japonii (MLX01) i w Niemczech (TR-08).

W laboratorium Katedry Automatyki EAIiIB AGH znajduje się stanowisko przeznaczone do badania magnetycznej lewitacji. Obiektem unoszącym się jest metalowa sfera. Pole magnetyczne jest wytwarzane przez cewkę umieszczoną ponad sferą. Dzięki pracom [1], [?] i [?] wiemy w jaki sposób modelować zachowanie układu, a także identyfikować jego parametry fizyczne.



Rysunek 1: Schemat stanowiska służący do wyznaczania równań, źródło [?]

Z prawa Faradaya, z prawa Kirchoffa ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= 10^{-3}g(1 - f(x_1(t)x_3^2(t))) \\ \dot{x}_3 &= -\frac{1}{T}x_3(t) + \frac{k}{T}(u(t) + u_c) \end{cases} \tag{1}$$

Funkcję f wpisać we wzór

2 Identyfikacja

2.1 Identyfikacja charakterystyki czujnika położenia

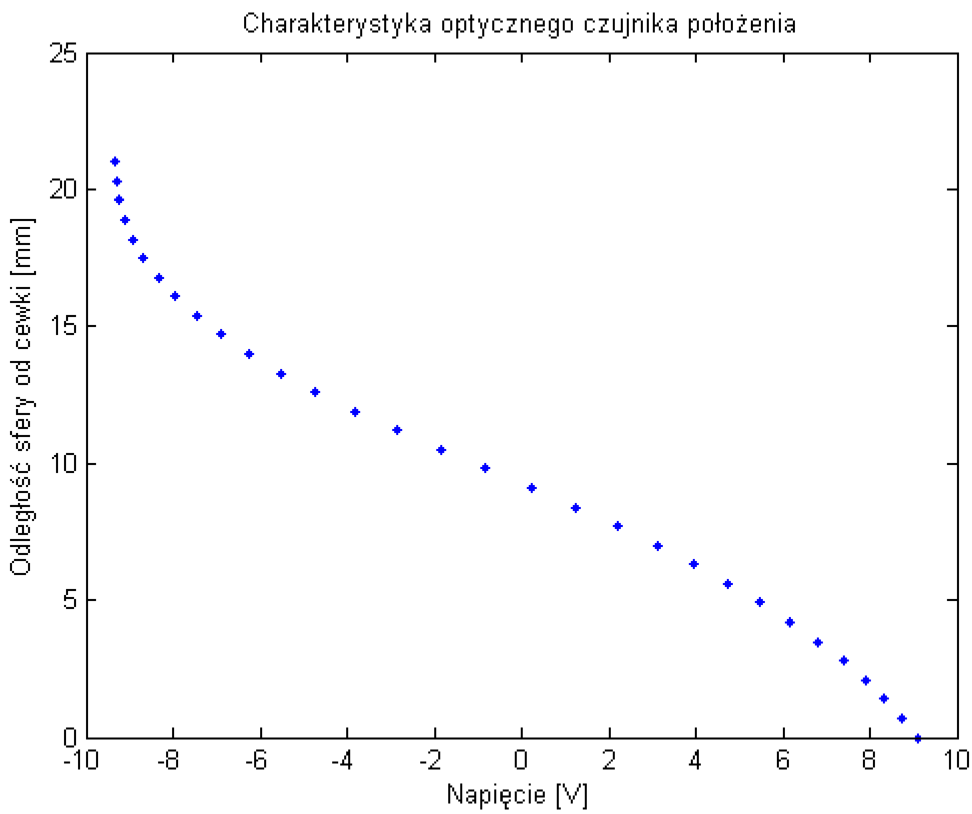
Pomiar położenia sfery w układzie magnetycznej lewitacji jest dokonywany optycznie. Z jednej strony znajduje się źródło światła, a po przeciwnej stronie fotodioda z przetwornikiem A/C, która podaje pewne napięcie u_x. Podczas identyfikacji poszukujemy zależności tego napięcia od położenia sfery:

$$u_x = g(x_1) \tag{2}$$

Poszukujemy charakterystyki statycznej $g(x_1)$, którą otrzymamy przykręcając sferę do śruby i podnosząc ją co ustalony skok 0,7 mm. Za każdym razem dokonujemy pomiaru napięcia podanego przez detektor światła.

Do pracy z modelem potrzebna jest znajomość położenia sfery, dlatego na rysunku 2 charakterystyka odwrotną do zależności 2.

[trzeba przeskalować napięcie jeszcze, można zrobić wykres od -ux]



Rysunek 2: Charakterystyka statyczna optycznego czujnika położenia

W pracy [1] autor dokonał aproksymacji otrzymanej charakterystyki odwrotnej sumą funkcji wykładniczych metodą prób i błędów. Nie będziemy dokonywać takiej aproksymacji, ponieważ podczas pracy z modelem w laboratorium użyjemy bloku *LUT z interpolacją* oferowanego przez Simulink.

2.2 Identyfikacja parametrów cewki k, T, u_c

Aby wiedzieć, jak zmienia się prąd cewki w zależności od użytego sterowania, czyli przyłożonego napięcia u, należy wyznaczyć parametry k, T oraz u_c.

2.2.1 Pomiary w stanie ustalonym cewki

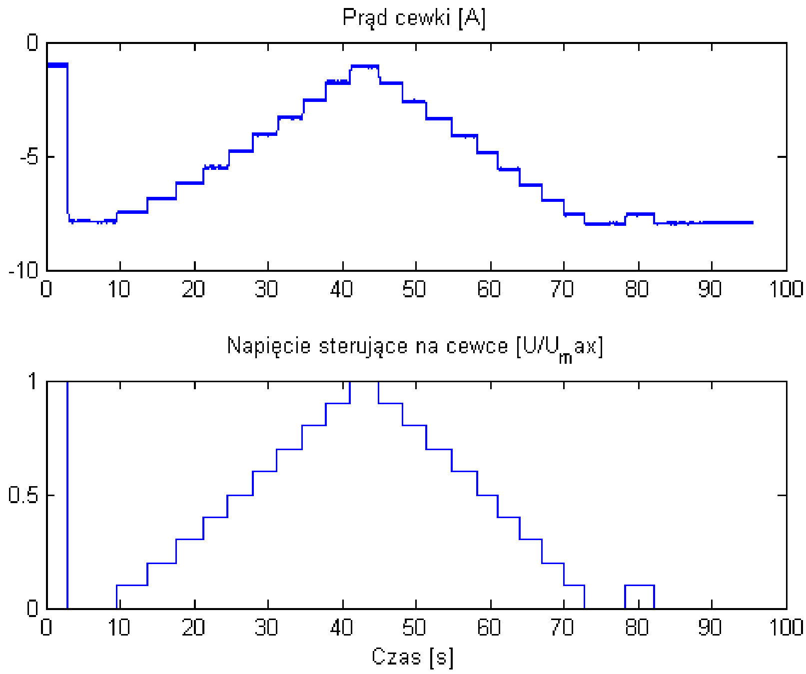
Zależność prądu od napięcia jest liniowa

$$i = k(u + u_c) \tag{3}$$

Parametry k i u_c (wzmocnienie oraz stałe napięcie na cewce) wyznaczymy mierząc prąd w stanie ustalonym dla różnych wartości napięcia sterującego.

- prąd w zależności od napięcia sterującego pomierzony, jakie jest przeskalowanie? Czy lepiej użyć oscyloskopu / czy jest rezystor?

[można też mierzyć spadek napięcia na rezystorze pomiarowym bo są duże błędy prądu]



Rysunek 3: Identyfikacja parametrów statycznych cewki

2.2.2 Pomiary stanów przejściowych cewki

Stałą czasową T można wyznaczyć obserwując odpowiedź skokową prądu.

...

...

Korzystając z metody najmniejszych kwadratów wyznaczono parametry, których wartości umieszczono w tabeli.

Wyrażenie	Wartość
k	...,
T	...,..
u_c	..,.

2.3 Identyfikacja indukcyjności cewki $L(x_1)$

W celu identyfikacji zależności indukcyjności cewki od położenia w układzie otwartym należy wykonać serię pomiarów napięcia i prądu dla różnych położeń sfery. Zmierzona rezystancja cewki wynosi $R =$ ... Indukcyjność obliczymy ze wzoru

$$L = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R^2} \tag{4}$$

gdzie ω - częstość napięcia zasilającego ($\omega = 314$ rad/s) U - napięcie skuteczne na cewce [V] I - prąd płynący przez cewkę [A] R - rezystancja cewki

[wykres doświadczenia]

Znaleziona funkcja ma postać $L(x_1) = ...$

Literatura

[1] Piotr Bania. Model i sterowanie magnetyczną lewitacją. praca magisterska, 1999.